

(19)  
(12)

(KR)  
(A)

(51) 。 Int. Cl.7  
G02F 1/13

(11)  
(43)

10-2004-0050045  
2004 06 14

(21) 10-2003-0087036  
(22) 2003 12 03

(30) JP-P-2002-00350950 2002 12 03 (JP)

(71) 가 가 2 4-1

(72) 가 3 3-5 가 가

가 3 3-5 가 가

(74)

:

(54) , , ,

(2) (20) (1) , (20)  
) . , , .

1

1 1 ,

2 2 ,

3 2 I-I ,

4 (11) ,

5 (10) ,

6 3 ,  
 7 (2B) ,  
 8 EL ,  
 9a 9c 7 .

1 : 1A :  
 2, 2A, 2B, 2C : 3A, 3B :  
 10 : 11 :  
 12 : 13, 13A :  
 14, 14A, 14B : 15 :  
 16, 18 : 17 :  
 19A, 19B : 20 :  
 30 : 50 :  
 61 : 가

, , ,  
 , , ,  
 , , , ( , )  
 , , ( , EL ) , 가 ,  
 , ( ) (高)  
 , EL ,  
 , TFD(Thin Film Diode), TFT(Thin Film Transistor) , 가  
 , 가 ,  
 , 가 ,  
 , 가 , 가 , 가 ,  
 , 가 , 가 , 가 ,

가 , 가 가 , , . , 0.05mm  
( 1 ).  
1 10-41069 (5 )

가 , 가 , 가 , 가 , 가 , 가 , 가 , 가 ,  
( 가 ) 가 , 가 , 가 , 가 ,  
가 , 가 , 가 , EL ,

가

가

가

가

가

가

가

(GaAs)

가

가

(Si)

가 가

가

( 1)

1 1 1 (20: )  
 가 (50) (20) ( ) :1) (20)  
 (20) (1) (1) (2) ( , :1A) 가 (Johnson  
 -Rahbek) (1) ) (1A) (20) ( ) )  
 (20) (20) (1)  
 ( ) (20) (2) , (1)  
 ( )  
 (2) 가 (2) (30)  
 (2) 가 가 (2)  
 20) (20) , 1 , 2 가 (2) (2) ( )  
 (3A, 3B) , CCD (2) (20)  
 (50) 가 (1)  
 ) (50) ( ) 가 (20) (20) (2)  
 ) ( ) 가 ( ) ( ) (2)

(1) 가 (20) (2)

(3A, 3B) 2 (1) (20)

, 61 (50) 가 ,가 가 (61)

(20) (1A) (3A, 3B)가 (20) (1) (20) (1)

(2) (20) ,가 20 $\mu$ m (1) 20 $\mu$ m

(20) 가 (2) 20 $\mu$ m (2) (20) (1)

(1) (20) (1) (20) 가 (2)가 (1)

(2) (20) (2)

가 (61) 가 (1) (20)

(2) (20)

(1)

(20) 1 (20) (1) (20)

(2) (20) 가 가 (20)

(2)

( 2)

2 (11) 2 (2A) 2 (2A)

(11) (11) (10)

) , 2 (11) (10) 9 (11) (10) (10)

(12) (11)

3 (2A) I-I 3 가

( , SiO<sub>2</sub> ) (14)

4 (11) 4 (11)

(13) (13) 가 (13)

(13) (13) 1 $\mu$ m SiO<sub>2</sub> (14) ( 4(a)).

(14) , CVD(Chemical vapor deposition) (14A)

O<sub>2</sub> 가 (14) , 가 SiO<sub>2</sub> , Si  
 (111) (13) ( 4 (b)). , SiO<sub>2</sub> ,  
 (KOH) , (111)  
 (15) (16) ( 4(c)). (111) , 54.7 °  
 (15) ( ) , (16)  
 (15)가  
 (11) 가  
 SiO<sub>2</sub> ( 4 (d)). , BHF(  
 ) SiO<sub>2</sub> (11)가  
 5 (10) 5 (10)  
 (18) ( 5 (a)). (10) (17) 가 , 가  
 (18) 가 , 가  
 (11) , Au/Cr( )  
 (12) (12) ( 5 (b  
 ))).  
 (11) ( 5 (c)). (12)  
 (10) 가 가 , (2A) (11)  
 2 , 가 가  
 ( 3)  
 6 3 (2B) , (10)  
 (11) ,  
 , 12 20cm  
 (19A), (19B) Au/Cr( )  
 가 , ( )  
 7 (2B) 2 , (11) , (13A)  
 , CVD SiO<sub>2</sub> (14A) ( 7(a)).  
 Au/Cr( ) ,  
 (19A) Au/Cr (19A, 19B) ( 7(b)).  
 (19B) ( 7(b))  
 2000~3000 (2~3×10<sup>-7</sup> m) ,  
 ,  
 SiO<sub>2</sub> , SiO<sub>2</sub>

7(d). SiO<sub>2</sub>가 (14A) (7(c)). (KOH) (111) (13A) (14B) (7(e)). Au/Cr (2B) CVD SiO<sub>2</sub>가 (2~3×10<sup>-7</sup> m)가 (2000~3000) EL (CMP(Chemical-Mechanical Polishing) SiO<sub>2</sub> (7(f)). SiO<sub>2</sub> (2B) 3 (2B) (4) 3 Au/Cr (11) (12) (11)가 2 (5) 가 가 (6) 8 6 EL EL R( ), G( ) B( ) 3 (20) (20) ) R, G, B 가 (20) TFT (2C) 가 2 (3) 가 1 8 (20) TFT (20) (20) (1) (2A) (50) (20) (20) (20) (2A) R (2C) (2C) (1)가 2 3 (2C) (2C) (2C) (8(a)). R (20) , R BSB-BCN . R (20) (2C) G (1) (8(b)). 가 ) EL (20) G (2C) G (1) (8(b)). , B 가 1 , B ( 8



(c).

, /  
,  
, / (2C) / , /  
, , /

( 7)

9A~9C 7 9A PDA(Personal Digital Assista  
nt), 9B , 9C , ,

가

(57)

1.

2.

3.

4.

3

5.

6.

7.

8.

9.

7 8 ,

10.

7 8 ,

11.

10 ,

12.

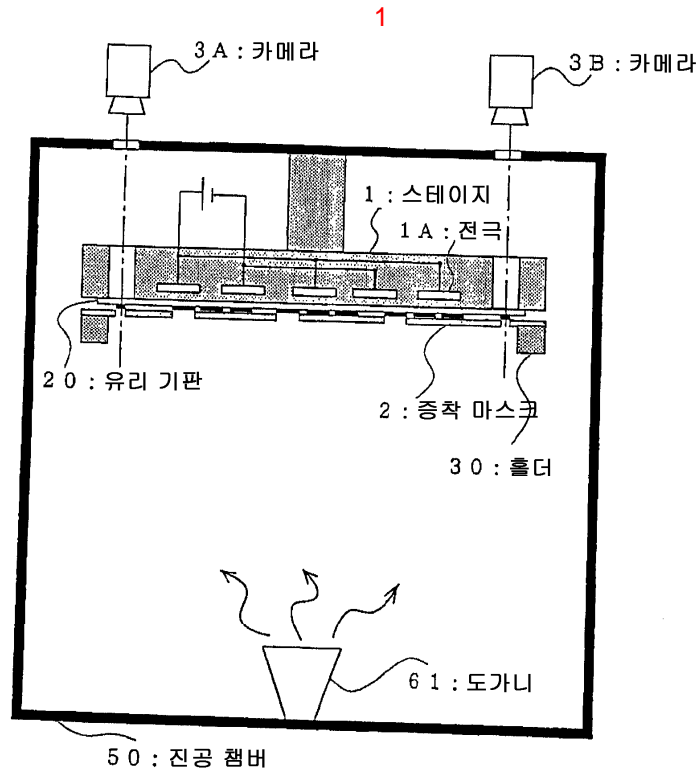
7 8 ,

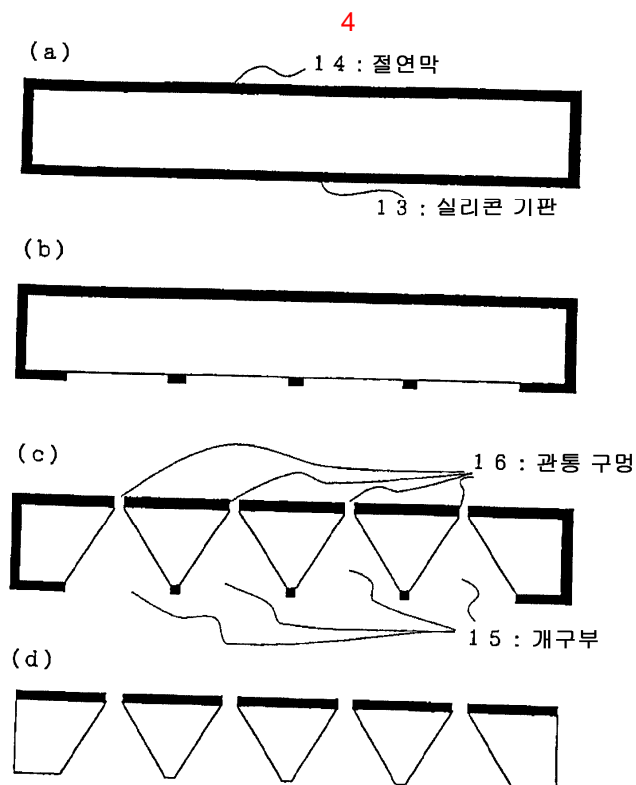
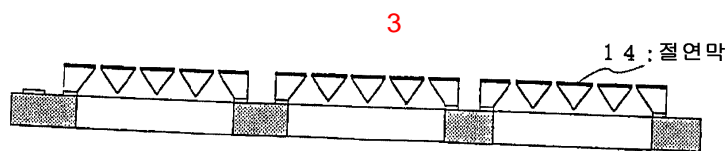
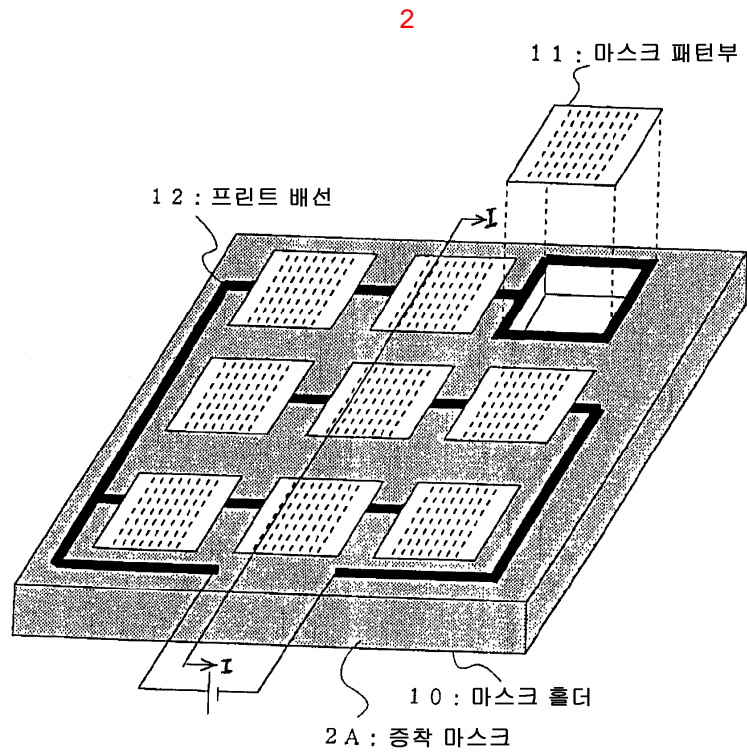
13.

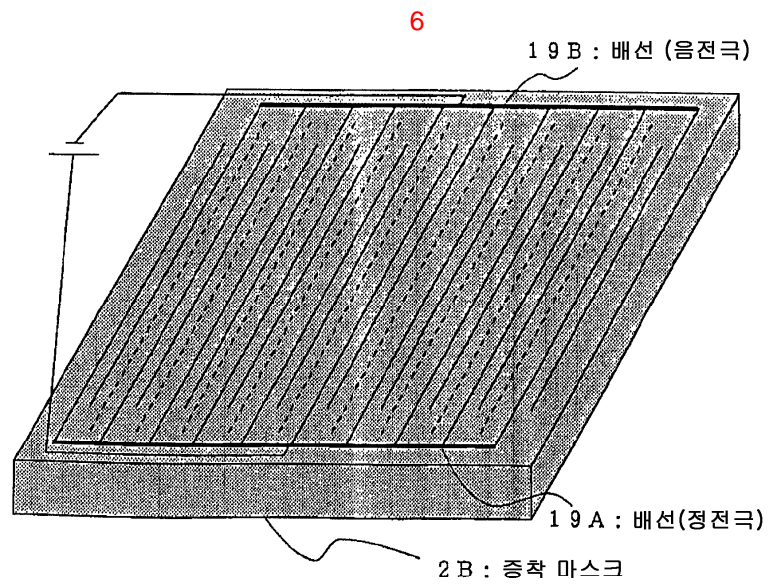
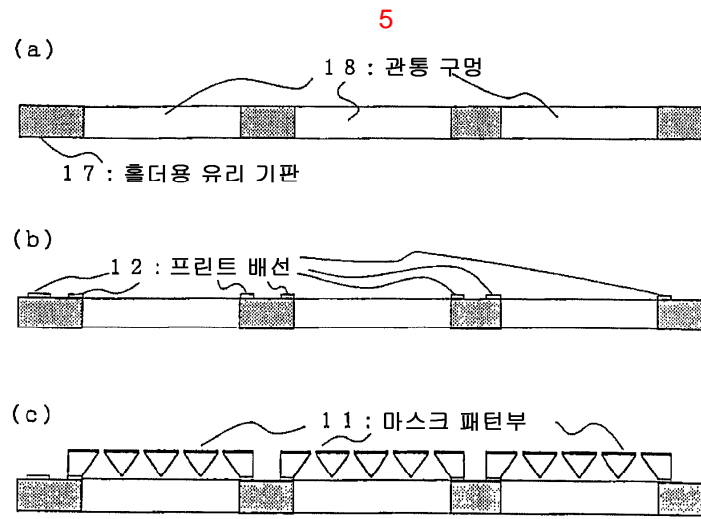
가

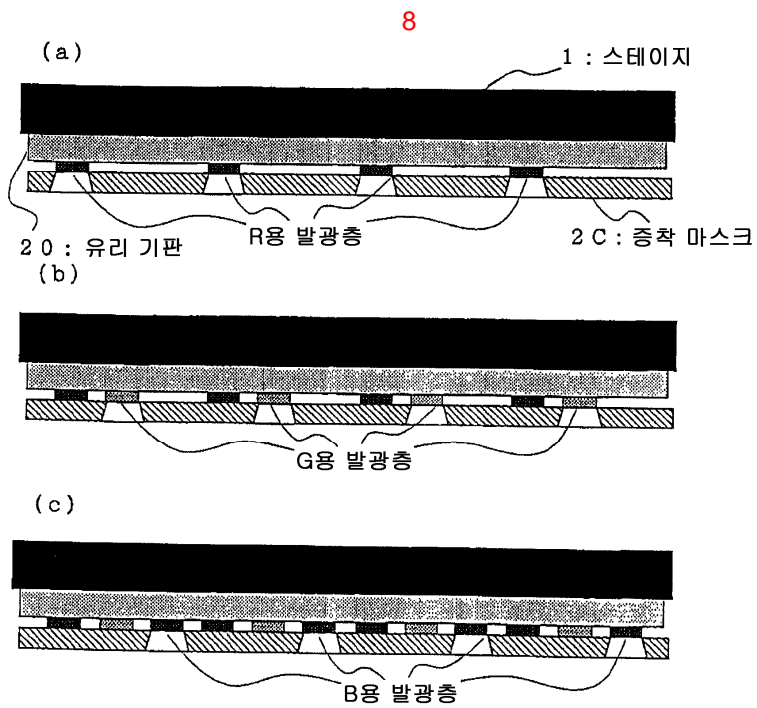
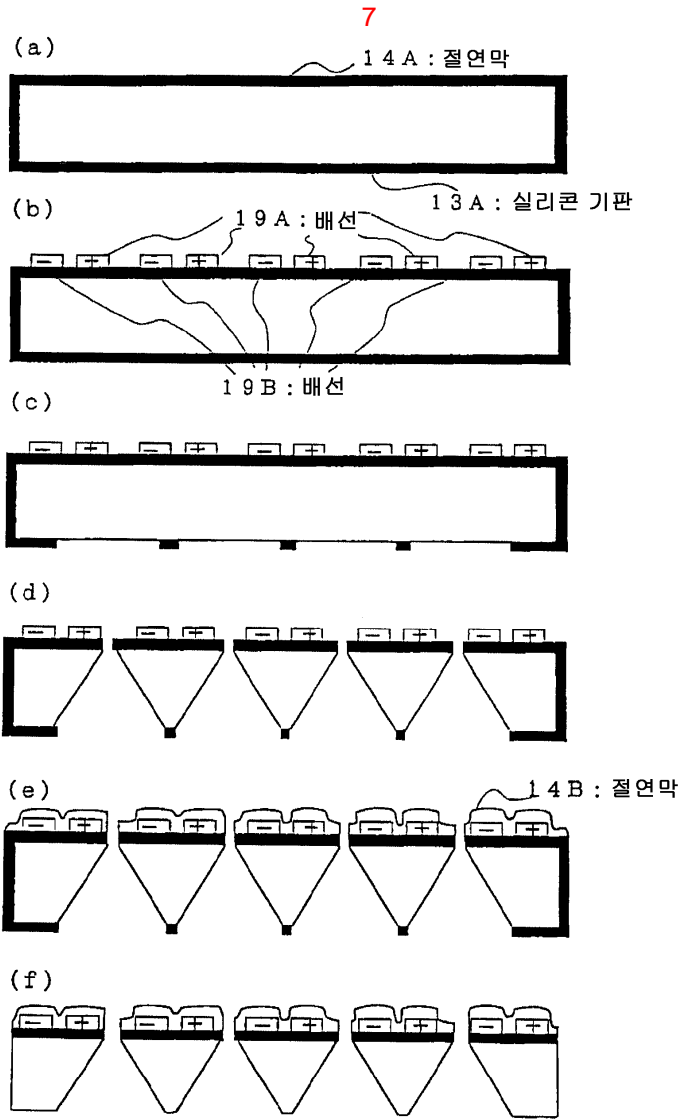
14.  
13

15.  
14



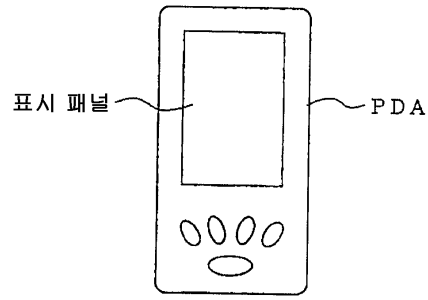






9

(a)



(b)



(c)

